

А. Г. НИКИТЕНКО, Ю. В. ТРОИЦКИЙ
(Новосибирск)

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ЗЕРКАЛА С АМПЛИТУДНОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ

Использование лазерных зеркал с пропусканием, зависящим от координаты, открывает новые возможности управления характеристиками излучения ОКГ. Можно, например, получать лазерные пучки с произвольным (в том числе П-образным) распределением интенсивности [1, 2] или осуществлять неоднородный вывод энергии высших по-перечных мод [3]. Применение таких зеркал позволяет воздействовать на характеристики мод оптического резонатора [4, 5], в том числе нестабильного [6]. Далее, эти зеркала могли бы в принципе совмещать (при увеличении общего КПД) функции лазерного зеркала и аподизирующего пространственного фильтра, необходимого для подавления самофокусировки излучения мощных лазеров [7].

В работе [1] обращено внимание на то, что при использовании неоднородного зеркала в качестве элемента оптического резонатора необходимо обеспечить неизменность фазы коэффициента отражения по поверхности зеркала, иначе в резонатор будут вноситься большие дифракционные потери.

В настоящей работе рассматривается вопрос об изготовлении эквифазных зеркал со ступенчато-изменяющейся амплитудой коэффициента пропускания. Эксперименты, выполненные в [1—3], основывались на двух методах изготовления неоднородных зеркал, предложенных в [1]. В этих методах: 1) использовалась независимость фазы коэффициента отражения от числа слоев многослойного диэлектрического покрытия, состоящего из четвертьволновых слоев двух диэлектриков, 2) геометрический фактор в набеге фазы был исключен благодаря обращению зеркала подложкой внутрь резонатора. Недостаток описанных в [1] вариантов зеркал заключается в том, что большое отношение пропусканий двух областей зеркала может быть получено лишь за счет большой разницы числа напыляемых на эти области диэлектрических слоев. Это приводит к увеличению переходной зоны между двумя областями зеркала и в результате — к снижению эффективности всей системы, особенно в случае лазерных пучков с малыми размерами, например в полупроводниковых лазерах и резонансных преобразователях пучков [2].

В настоящей работе предлагается новый способ изготовления неоднородных зеркал, в котором большой контраст по пропусканию получается при различии всего на единицу в числе четвертьволновых слоев. Схема зеркала показана на рис. 1. Область b имеет малое энергетическое пропускание T_b , область a — пропускание T_a , $T_a > T_b$. Отражающее покрытие наносится в три этапа. Первый состоит в том, что на всю поверхность подложки наносится N четвертьволновых слоев двух диэлектриков с чередующимися показателями преломления n_h и n_l . На рисунке эти слои обозначены I, $N=10$. На втором этапе область a закрывается маской и на оставшуюся часть поверхности зеркала наносится один четвертьволновый слой (II на рис. 1) диэлектрика с таким же показателем преломления (n_h на рис. 1), как и у ($N-1$)-го слоя. Затем маска удаляется, и на третьем этапе на всю поверхность зеркала наносятся диэлектрические слои (III на рис. 1), число которых N' , а показатель преломления первого из них одинацков с показателем

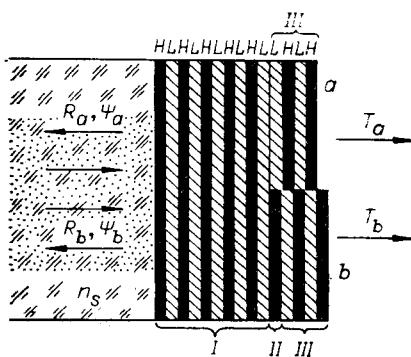


Рис. 1. Схема изготовления зеркал со ступенчатым изменением пропускания.

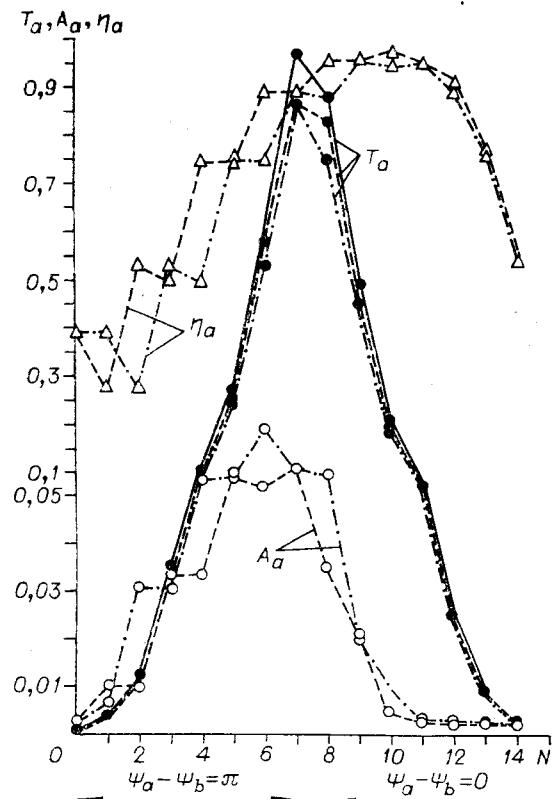


Рис. 2. Зависимость пропускания, поглощения и КПД области *a* неоднородного зеркала от числа слоев первого этапа напыления:
 Ψ_a и Ψ_b — фазы коэффициента отражения областей *a* и *b* соответственно.

преломления N -го слоя (например, слоя L на рис. 1). В результате на область *b* оказывается нанесенным $N+N'+1$ слоев с правильным чередованием диэлектриков. Эта область имеет малое пропускание T_b . В отличие от этого пропускание T_a в области *a* значительно больше: такое же, как и у $(N-N')$ -слойника с правильным чередованием. Покрытие в области *a* можно рассматривать как настроенный интерферометр Фабри—Перо, два зеркала которого образованы соответственно N - и N' -слойниками. При $N=N'$ получается частный вариант, обычно используемый в интерференционных светофильтрах. Для наших целей $N>N'$. Расчет нескольких конкретных структур показал, что при таком способе изготовления неоднородных зеркал можно получить большие отношения T_a/T_b . В качестве характерного примера таких зеркал на рис. 2 представлены результаты расчета структуры зеркала на кварцевой подложке ($n_s=1,46$) при $N+N'+1=15$, $n_L=1,35$ и $n_H=2,32$. Считалось, что к подложке прилегает слой n_H . Число N однородных слоев, наносимых на первом этапе, было различным; его значения отложены по горизонтали на рис. 2 (конечно, имеют смысл лишь целые N). При помощи ЭВМ с использованием рекуррентных формул Власова [8] были рассчитаны величины коэффициентов пропускания T_a , T_b , отражения R_a , R_b и поглощения $A_a=1-T_a-R_a$ областей *a* и *b*. На рис. 2 показаны значения T_a , A_a и $\eta_a=T_a/(T_a+A_a)$ — «коэффициента полезного действия» покрытия, зависящего от соотношения поглощенного и проходящего света. Необходимо обратить внимание на десятикратное изменение масштаба по вертикальной оси при значении ординаты 0,05. Точки, соединенные сплошной ломаной линией, получены в отсутствие поглощения в слоях: когда мнимые части показателей преломления χ_H и χ_L равны нулю. В этом случае $A_a=0$, $\eta_a=1$, $T_b=0,055 \cdot 10^{-2}$. Как и следовало ожидать, при увеличении N T_a сначала возрастает, достигает максимума ($N=7$, $T_a=0,96$), а затем начинает спадать.

Значения $N \leq 8$ для лазерных зеркал непригодны, так как фазы ψ_a и ψ_b коэффициента отражения от областей a и b различаются на π (однако такие зеркала могут оказаться полезными для селекции исключением области максимальных T_a). На рис. 2 приведены также результаты расчетов T_a , A_a и η_a для $\lambda = 0,63$ мкм при $x_L = 0$, $x_H = 10^{-3}$ (штриховые линии) и при $x_L = 10^{-3}$, $x_H = 0$ (штрихпунктирные линии). Очевидно, что коэффициент поглощения света в зеркале в этом случае уже не равен нулю. Если он мал, то, как показывают расчеты, при неизменной структуре покрытия он линейно зависит от x_L и x_H :

$$A_a = C_1 x_L + C_2 x_H.$$

Данные рис. 2 позволяют найти C_1 и C_2 при каждом заданном N и, следовательно, величину A_a при произвольных значениях x_L и x_H .

Для структуры, характеристики которой представлены на рис. 2, большие значения η_a получаются при $N = 10 \div 13$. Например, при $N = 10$, $x_H = 10^{-3}$ и $x_L = 0$ $T_a = 0,1978$, $A_a = 0,49 \cdot 10^{-2}$, $\eta_a = 0,97$. При этих же x_L и x_H для областей b получаем $T_b = 0,055 \cdot 10^{-2}$, $A_b = 0,25 \cdot 10^{-2}$. Таким образом, контраст пропусканий областей a и b очень велик: $(T_a/T_b) \approx 340$. Следует отметить, что рассмотренная конкретная структура зеркала позволяет получить при хорошем η_a лишь четыре значения T_a : $45,8 \cdot 10^{-2}$; $19,8 \cdot 10^{-2}$; $7,19 \cdot 10^{-2}$; $2,54 \cdot 10^{-2}$. Если нужны промежуточные значения, то следует варьировать показатели преломления диэлектриков и менять их местами. Однако можно поступить проще: сделать слой II не четвертьволновым. Если в данной системе плавно изменять его толщину от 0 до $\lambda/4$, то, например при $N = 11$, T_a плавно изменяется от $19,78 \cdot 10^{-2}$ до $0,055 \cdot 10^{-2}$. При этом, очевидно, Ψ_a уже не будет равно π , но это изменение «экранируется» N -слойником I , и на границе подложка — покрытие вариация фазы может оказаться допустимой. Расчет показывает, что при $N = 11$ отклонение Ψ_a от π не превышает $6 \cdot 10^{-3}\pi$. Обнаруженный эффект «экранировки» фазы многослойником в принципе дает возможность реализовать «почти эквифазные» зеркала с плавным изменением амплитуды пропускания по поверхности, например гауссовым [4, 6].

Таким образом, предложенный здесь метод позволяет легко осуществить эквифазные неоднородные отражатели с резкими границами областей и высоким контрастом по пропусканию. Недостатком таких зеркал можно считать их резонансный характер, в результате чего несколько увеличиваются потери на поглощение в слоях. Возможно, это создает также увеличенную избирательность по λ . Если это недопустимо, то следует ориентироваться на схему зеркала, изображенную на рис. 1, б в [1], хотя границы и контраст для нее несколько хуже.

По предложенному методу было изготовлено зеркало для $\lambda = 0,63$ мкм с $N = 11$ и общим числом слоев, равным 15. Область повышенного пропускания имела вид квадрата со стороной 0,5 мм. Полученные значения T_a и T_b составили соответственно $4,5 \cdot 10^{-2}$ и $0,3 \cdot 10^{-2}$. Ширина переходной зоны была равна примерно 5 мкм. Испытание в Не-Не-лазере показало, что дополнительные потери, связанные с неоднородностью зеркала, малы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Троицкий Ю. В. Равномерное освещение при помощи газового лазера.— «Опт. и спектр.», 1974, т. 37, вып. 5, с. 973—978.
2. Курбатов П. Ф., Троицкий Ю. В. Получение негауссовых световых пучков при помощи интерферометра Фабри—Перо с неоднородным зеркалом.— «Опт. и спектр.», 1975, т. 38, вып. 6, с. 1217—1218.
3. Троицкий Ю. В. Неоднородный вывод энергии высших поперечных типов колебаний в газовом оптическом квантовом генераторе.— «Квант. электроника», 1974, т. 1, № 1, с. 124—128.
4. Вахитов Н. Г. Открытые резонаторы с зеркалами, обладающими переменным коэффициентом отражения.— «Радиотехника и электроника», 1969, т. 10, № 9, с. 1676—1683.
5. Власов С. Н. Резонаторы с зеркалами с переменным коэффициентом отражения.— «Радиотехника и электроника», 1965, т. 10, № 9, с. 1715—1718.
6. McAllister G. L., Steier W. H., Lacina W. B. Improved mode properties of unstable resonators with tapered reflectivity mirrors and shaped apertures.— “IEEE J. Quant. Electr.”, 1974, vol. QE-10, N 3, p. 346—355.
7. Campillo A. J., Carpenter B., Newnam B. E., Shapiro S. L. Soft apertures for reducing damage in high—power laser—amplifier systems.— “Opt. Commun.”, 1974, vol. 10, N 4, p. 313—315.
8. Гребенников И. В., Власов А. Г., Непорент Б. С., Суйковская Н. В. Просветление оптики. М.—Л., Гостехиздат, 1946.
9. Троицкий Ю. В. Использование многолучевого фазового интерферометра для получения одночастотной генерации в лазерах.— «Квант. электроника», 1975, т. 2, № 11, с. 2444—2451.

Поступила в редакцию 6 апреля 1978 г.;
окончательный вариант — 27 июля 1978 г.

УДК 681.327.17

В. М. МАТЮХИНА, В. Н. РЕБИТВА, Е. А. ФИГУРОВСКИЙ,
Я. Г. ХУСАИНОВА

(Новосибирск)

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

При исследовании одиночных фотоприемников и матричных фотоэлектрических преобразователей существует ряд задач, решение которых требует генерации импульсного излучения в заданном спектральном диапазоне с весьма широкой регулировкой энергии излучения.

Использование ОКГ с электрооптическими и акустооптическими модуляторами не удовлетворяет поставленным условиям по нескольким причинам. Большой остаточный поток на выходе электрооптического модулятора при полном затемнении (3—7%) резко уменьшает динамический диапазон регулировки энергии [1]. Акустооптический модулятор (дефлектор) не позволяет получить импульс излучения короче нескольких микросекунд из-за малого быстродействия дефлектора и инерционности схемы управления [2]. Нестабильность уровня излучения ОКГ и изменение его модового состава целиком определяют колебания промодулированного потока: они составляют 30—40%; реальный динамический диапазон регулировки энергии не превышает 1,5÷2 порядка.

Значительно лучший результат можно получить при использовании в качестве генераторов излучения быстродействующих инжекционных диодов на основе фосфида и арсенида галлия [3, 4]. При этом может быть достигнут широкий динамический диапазон регулировки энергии излучения, составляющий 4 порядка и более, а нестабильность энергии импульса излучения может быть снижена до единиц процентов.